



(10) **DE 11 2008 000 723 A5** 2012.06.14

(12)

## Hinweis auf die internationale Veröffentlichung in deutscher Sprache

der internationalen Anmeldung mit der  
(87) Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung  
in deutscher Sprache: **WO 2008/123459**  
(21) Deutsches Aktenzeichen: **11 2008 000 723.3**  
(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/JP2008/056209**  
(86) PCT-Anmeldetag: **28.03.2008**  
(87) PCT-Veröffentlichungstag: **16.10.2008**

(51) Int Cl.: **H01L 21/66** (2006.01)  
**G01B 11/24** (2006.01)

(30) Unionspriorität:  
**2007-091343**      **30.03.2007**      **JP**

(74) Vertreter:  
**Benedum, Ulrich, 80333, München, DE**

(71) Anmelder:  
**Shibaura Mechatronics Corp., Yokohama,  
Kanagawa, JP**

(72) Erfinder:  
**Hayashi, Yoshinori, Yokohama, Kanagawa, JP;  
Mori, Hideki, Yokohama, Kanagawa, JP**

(54) Bezeichnung: **Vorrichtung und Verfahren zum Prüfen der Kante eines Halbleiterwafers**

Der vollständige Inhalt dieser PCT-Anmeldung ist der Original-Veröffentlichung der WIPO (in deutscher Sprache) zu entnehmen.

Die WO-Veröffentlichung mit der Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung unter INID-Code (87) kann unter <http://depatisnet.dpma.de> eingesehen werden.